

カスタムPtfе製 凝還流蒸留精製システム 500Ml 耐食性 低バックグラウンド

商品番号: PL-CP83



前書き

蒸留・精製用のプロフェッショナルな高純度PTFE凝縮還流装置です。このカスタマイズ可能な500mlシステムは、要求の厳しい実験環境でのトレース分析や敏感な化学反応に対し、優れた耐食性と低バックグラウンド干渉を提供します。

詳細を学ぶ

用途	説明	主な利点
微量金属の精製	半導体分析や環境分析で使用される超純酸(HNO ₃ , HCl, HF)の蒸留	サブpptレベルのバックグラウンドを実現し、イオン溶出を排除
医薬品合成	創薬プロセスにおける反応性の高い有機中間体や触媒の還流	ガラス由来不純物による汚染を防止し、反応安定性を確保
同位体地球化学	濃フッ化水素酸を用いた地質材料のサンプル分解・還流	ガラス装置を溶解してしまうHFに対して完全な耐性を発揮
特殊化学品研究開発	制御された環境下での高純度モノマー・ポリマーの蒸留・精製	非反応性の流体経路を提供し、ポリマー純度を維持
環境モニタリング	残留性有機汚染物質検出のための水サンプルの濃縮・精製	非粘着表面特性により高回収率を実現
電池材料試験	電解液成分やリチウムイオン電池前駆体材料の還流	反応性の高いリチウム塩や溶媒存在下で化学的安定性を維持
石油化学分析	品質管理や硫黄分析のための原油留分・精製品の蒸留	高温下で腐食性の硫黄化合物に対して耐性を発揮

特性	仕様詳細 (モデル PL-CP83 シリーズ)
モデル識別子	PL-CP83
主要構造素材	高純度PTFE / PFA (熱要件に応じてカスタマイズ可能)
標準容量	500ml (ご要望に応じて別容量も提供可能)
設計構成	モジュール式還流・凝縮アセンブリ
動作温度範囲	-200°C ~ +260°C
化学適合性	万能 (溶融アルカリ金属およびフッ素ガスを除く)
製造方法	フルカスタムCNC加工
シール機構	精密加工ネジ継手 / Oリングフリー設計 (オプション)
凝縮器タイプ	リービッヒ型、グレラム型、またはカスタム内部コイル設計
表面仕上げ	Ra < 0.4 μm (高純度機械加工仕上げ)
カスタマイズオプション	入出力ポートサイズ、センサーサーモウェル、ジャケット冷却ゾーン